

## 45<sup>th</sup> International Symposium on Dry Process (DPS2024)

開催場所：Chitose, Hokkaido.

開催日程：2024/11/14~15

学会 HP：<https://www.dry-process.org/2024/>

今回の会議は、北海道千歳市で開催され、高性能半導体製造で注目を集めるラピダス社の建設中工場から近いこともあり、多くの参加者が集まりました。参加者数は360名で、内訳は日本257名、韓国が53名、台湾20名、米国11名、中国8名、ベルギー3名、フランス2名、インドネシア2名、ドイツ1名、オランダ1名、ハンガリー1名と、昨年より参加者が約30名増加しました。

会議では合計99件の発表が行われ、特別講演が7件、一般口頭発表が20件、ポスター発表が72件と、幅広いテーマが取り上げられました。基調講演ではラピダス社の小池淳義社長が、2nm ロジック半導体製造への挑戦について語りました。招待講演では、IMECのIlgyo. G. Koo氏、ラムリサーチのRich Wise氏、サムソン電子のKukhan Yoon氏が登壇し、それぞれの分野での最新の技術や研究成果について発表しました。

授賞式では、DPS Nishizawa Award がコロラド大学のSteven M. George教授（原子レベルの表面反応の理解と応用への貢献）と、ソニーセミコンダクタソリューションズの辰巳哲也氏（フルオロカーボンプラズマによるドライエッチングのメカニズム解明への貢献）に授与されました。また、DPS Achievement Award は中部大学の中村圭二教授（反応性プラズマ中の電子密度計測の確立への貢献）と、SONPO リスクマネジメント社の大岩徳久氏（半導体製造におけるエッチングプロセス開発への貢献）に贈られました。さらに、Best Presentation Award は東京エレクトロン宮城社の須田隆太郎氏ら6名、DPS Paper Award はキオクシア社の阿部知央氏ら9名に贈られました。

次回のDPS2025は愛媛県松山市で開催予定で、会場となる子規記念博物館は、日本三古湯のひとつである道後温泉地区に位置しています。愛媛県の魅力的な観光資源も紹介され、次回も盛会が期待されています。



写真1 メイン会場

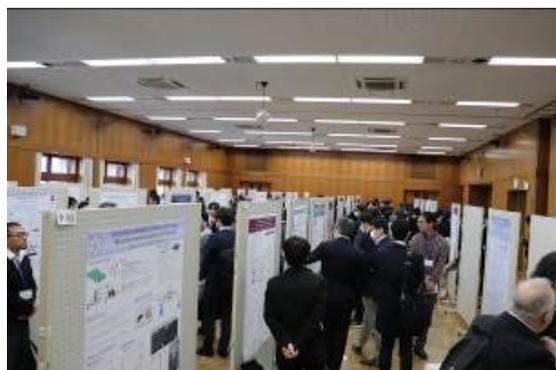


写真2 ポスター会場

図 学会会場の様子